

処分予定財産需要調査一覧表

事業等名：二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発事業

区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	取得価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
(イ)	リコーテレビ会議システム	S7000	1	939,435	939,435	2013/3/15	千代田区岩本町2-11-9 本部事務所	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	リコーテレビ会議システム	P3000	1	306,075	306,075	2013/3/15	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC K-11棟	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	リコーテレビ会議システム	P3000	1	306,075	306,075	2013/3/15	千代田区岩本町2-11-9 本部事務所	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	雰囲気式ロータリーキルン	MS-3150	1	3,268,125	3,268,125	2013/2/22	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部動力実験装置室1F	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	電気マッフル炉(FUW212PA)-8	FUW212PA	1	246,330	246,330	2013/2/20	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部動力実験装置室1F	継続使用:可 傷:無 特記事項:部品交換修理必要
(イ)	雰囲気式ロータリーキルン	MS-3150	1	3,268,125	3,268,125	2013/2/22	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部動力実験装置室1F	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	電気マッフル炉(FUW212PA)-4	FUW212PA	1	246,330	246,330	2013/2/20	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部動力実験装置室1F	継続使用:可 傷:無 特記事項:部品交換修理必要
(イ)	電気マッフル炉(FUW212PA)-10	FUW212PA	1	246,330	246,330	2013/2/20	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部動力実験装置室1F	継続使用:可 傷:無 特記事項:部品交換修理必要
(イ)	COMSOL Multiphysics 一式	C10K200-40xsp	1	1,890,000	1,890,000	2013/2/27	茨城県つくば市東 1-1-1 産業技術総合研究所 つくば中央第5 5-2 0241号室	継続使用:可 傷:無 特記事項:無

区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	取得価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
(イ)	レーザー回折/散乱式粒子径分布測定装置	LA-950V2-TU	1	8,437,800	8,437,800	2013/2/27	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC 第4本棟 4105	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	原子層堆積装置	TFS-200	1	35,490,000	35,490,000	2013/3/5	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部動力実験装置室1F	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	MATLAB (MLALL)	MATLAB	1	299,250	299,250	2013/2/5	茨城県つくば市東 1-1-1 産業技術総合研究所 つくば中央第5 5-2 0241号室	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	多元薄膜作製装置	EW-10/CZTS	1	39,900,000	39,900,000	2013/3/12	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部12号館別館 230	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	ハイクオリティモバイルPLD装置	MC-LMBE-K	1	33,862,500	33,862,500	2013/2/28	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部動力実験装置室 102	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	ガス循環精製機付き 真空式グローブボックス3式	1ADB-3KH-TDM2SK	1	7,591,500	7,591,500	2013/3/15	名古屋市昭和区御器所町宇木市29番地 名古屋工業大学2号館721A	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	エキシマーレーザー機器	COMPexPro 102- KrF-SV	1	8,778,000	8,778,000	2013/2/22	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部動力実験装置室1F	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	数値シミュレーション用パソコン	ThinkPad E530	1	239,400	239,400	2013/2/22	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部12号館 405	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	MTO分析装置	GC-2014A、GC- 2014ATFF、他	1	8,925,000	8,925,000	2013/3/4	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC 第4本棟 4204	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	MTO加圧流通反応装置	1式	1	7,192,500	7,192,500	2013/2/20	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC 第4本棟 4204	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	FTガスメーター	W-NH-1B型	1	1,730,400	1,730,400	2013/3/8	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC C11-101	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	高速小型ガス分析計	490-GC Quad Three Channel	1	3,937,500	3,937,500	2013/2/27	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC C11-101	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	光触媒評価用TCD-GC	INFICON 3000他	1	2,992,500	2,992,500	2013/3/1	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC C12棟	継続使用:可 傷:無 特記事項:修理・点 検整備要
(イ)	19管式パッフルモジュールユニット	L28cmフランジ付き円 筒分離膜モジュール	1	3,465,000	3,465,000	2013/3/18	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC 第4本棟 4205	継続使用:可 傷:無 特記事項:無

区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	取得価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
(イ)	多管中空糸膜モジュール	L13cm, 直径5-6.6cm 中空糸膜モジュール	1	2,100,000	2,100,000	2013/3/14	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC 第4本棟 4205	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	シングルコラム卓上試験機	5942	1	3,139,500	3,139,500	2013/3/18	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC 第4本棟 4205	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	ガスクロマトグラフー式	1式 GC-2025AF 2台 データ処理装置1台	1	4,103,400	4,103,400	2013/3/15	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC 第4本棟 4004	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	ガス組成分析制御解析装置	CP-4900	1	798,000	798,000	2012/12/17	愛知県名古屋市中熱田区六野2-4-1 JFCC研究棟R504	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	ガス組成分析制御解析装置	CP-4900	1	798,000	798,000	2012/12/17	愛知県名古屋市中熱田区六野2-4-1 JFCC研究棟R504	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	ガス組成分析制御解析装置	CP-4900	1	798,000	798,000	2012/12/17	愛知県名古屋市中熱田区六野2-4-1 JFCC研究棟R504	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	ガス組成分析制御解析装置	CP-4900	1	798,000	798,000	2012/12/17	愛知県名古屋市中熱田区六野2-4-1 JFCC研究棟R504	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	ガス組成分析制御解析装置	CP-4900	1	798,000	798,000	2012/12/17	愛知県名古屋市中熱田区六野2-4-1 JFCC研究棟R406,408	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	高精度ガス /蒸気吸着量測定装置	B・ELSORP-max-12- N-VP-F	1	10,500,000	10,500,000	2013/1/23	愛知県名古屋市中熱田区六野2-4-1 JFCC研究棟R406	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	自動比表面積 /細孔分布測定装置・前処理装 置	BEL sorp-mini II Bel prep-vac II	1	4,200,000	4,200,000	2013/2/12	愛知県名古屋市中熱田区六野2-4-1 JFCC研究棟R406	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	湿式スクラパー搭載型ドラフトチャン バー	TNG-STZ-1800ES	1	3,885,000	3,885,000	2013/2/22	愛知県名古屋市中熱田区六野2-4-1 JFCC研究棟R515	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	ドラフトチャンバー	DFV-11AK-15AA1	1	1,775,550	1,775,550	2013/2/19	愛知県名古屋市中熱田区六野2-4-1 JFCC研究棟R512	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	高温型熱重量示差熱分析装置	FUJITSU ESPRIMO・ TG-8120	1	3,139,500	3,139,500	2013/2/28	愛知県名古屋市中熱田区六野2-4-1 JFCC研究棟R408	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	自転公転式混練機	ARE-310	1	854,700	854,700	2014/1/28	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部12号館別館 221	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	湿式比表面積測定装置	AcornArea、Xigo	1	6,037,500	6,037,500	2014/1/28	神奈川県茅ヶ崎市本村2-8-1 TOTO株式会社茅ヶ崎工場研究3号棟 A330	継続使用:可 傷:無 特記事項:無

区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	取得価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
(イ)	湿式微粉砕分散機	DMS65	1	7,392,000	7,392,000	2014/1/30	神奈川県茅ヶ崎市本村2-8-1 TOTO株式会社茅ヶ崎工場研究3号棟 A330	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	多源基板正対型スパッタ装置	MPS-254	1	11,999,998	11,999,998	2014/3/12	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部動力実験装置室 1F	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	硫化炉システム部品	流量制御部 排気除害筒	1	5,610,150	5,610,150	2014/3/12	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部動力実験装置室 1F	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	卓上遠心機システム	5430R、F-35-6-30、 FA-45-16-17	1	790,282	790,282	2014/3/12	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部動力実験装置室 1F	継続使用:可 傷:無 特記事項:修理・点 検整備要
(イ)	スピンコーター	MS-A100	1	808,710	808,710	2013/11/18	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部12号館別館 221	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	原子層堆積装置の改造①	25TK006201(支払申 請書No.24-TK-061・ 24TK006200分)	1	184,401	184,401	2013/9/17	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部動力実験装置室1F	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	3D測定レーザー顕微鏡	OLS-4000	1	11,833,500	11,833,500	2013/10/7	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部12号館別館 325	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	原子層堆積装置の改造②	25TK006202(支払申 請書No.24-TK-061・ 24TK006200分)	1	609,777	609,777	2013/11/5	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部動力実験装置室1F	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	真空ラミネーター装置	LM-20×20(脚付き)	1	3,129,000	3,129,000	2013/11/5	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部動力実験装置室1F	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	長作動距離対物レンズ	ブランセミアポクロマー ト	1	533,925	533,925	2013/11/27	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部12号館別館 325	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	実体顕微鏡	M205C	1	1,699,538	1,699,538	2013/12/24	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部12号館別館 325	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	実体顕微鏡画像処理システム	M205C用画像センサ ディスプレイモニタ	1	250,782	250,782	2014/2/20	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部12号館別館 325	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	ALD装置TFS-200用部品	PRESSURE TRANSDUCER 750 C12MCB4GA	1	320,250	320,250	2014/2/21	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部動力実験装置室1F	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	低温循環水槽	RAB 43-0421-5	1	225,540	225,540	2013/6/10	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC C11-101	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	低温循環水槽	RAB 43-0421-5	1	225,540	225,540	2013/6/10	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC C11-101	継続使用:可 傷:無 特記事項:無

区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	取得価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
(イ)	水素ガス検知器	一式 PD-14A～D、モニターシステム	1	263,996	263,996	2013/7/3	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC C11-計器室	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	FT流通反応装置	高压流通反応装置 反応器容積200mL	1	29,400,000	29,400,000	2013/8/19	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC C11-101、計器室	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	タッチ型ペーパーレスレコーダー	TR-W550 本体 TR-TH08 計測ユニット (本体組込済) SJ-U2 ACアダプタ	1	309,750	309,750	2013/10/4	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC C41-113	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	膜モジュール102Lタイプ 他4件	分離膜評価用小型モジュール	1	662,550	662,550	2013/10/28	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC 第4本棟 4215	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	水熱合成反応装置	KH-02D(DRM620DB)	1	3,428,250	3,428,250	2013/10/28	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC C11-112	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	フィーダー(マイクロシリンジポンプレガート200)	レガート200	1	443,100	443,100	2014/1/14	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC 第4本棟 4215	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	ステンレス製外筒容器-1	200cc内筒用 L17cm, × Φ6-8.5cm	1	223,650	223,650	2014/1/21	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC 第4本棟 4205	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	ステンレス製外筒容器-2	200cc内筒用 L17cm, × Φ6-8.5cm	1	223,650	223,650	2014/1/21	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC 第4本棟 4205	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	ステンレス製外筒容器-3	200cc内筒用 L17cm, × Φ6-8.5cm	1	223,650	223,650	2014/1/21	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC 第4本棟 4205	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	ステンレス製外筒容器-4	200cc内筒用 L17cm, × Φ6-8.5cm	1	223,650	223,650	2014/1/21	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC 第4本棟 4205	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	ステンレス製外筒容器-5	200cc内筒用 L17cm, × Φ6-8.5cm	1	223,650	223,650	2014/1/21	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC 第4本棟 4205	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	ステンレス製外筒容器-6	200cc内筒用 L17cm, × Φ6-8.5cm	1	223,650	223,650	2014/1/21	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC 第4本棟 4205	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	ステンレス製外筒容器-7	200cc内筒用 L17cm, × Φ6-8.5cm	1	223,650	223,650	2014/1/21	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC 第4本棟 4205	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	ステンレス製外筒容器-8	200cc内筒用 L17cm, × Φ6-8.5cm	1	223,650	223,650	2014/1/21	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC 第4本棟 4205	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	ステンレス製外筒容器-9	200cc内筒用 L17cm, × Φ6-8.5cm	1	223,650	223,650	2014/1/21	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC 第4本棟 4205	継続使用:可 傷:無 特記事項:無

区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	取得価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
(イ)	ステンレス製外筒容器-10	200cc内筒用 L17cm, × Φ6-8.5cm	1	223,650	223,650	2014/1/21	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC 第4本棟 4205	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	高速GC	H2, O2分析用 本体、制御用PC	1	3,129,000	3,129,000	2014/2/14	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC 第4本棟 4215	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	手動復帰盤製作	実験装置用電源ボッ クス	1	202,876	202,876	2014/2/17	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC 第4本棟 4215	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	コリオリ式デジタル流量センサ	FD-SF1 FD-SA1NA OP-87137	1	233,625	233,625	2014/2/19	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC B13-102	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	リモートタイマー RT731C	ジーエルサイエンス製 RT731C	1	503,580	503,580	2014/2/26	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC C11-101	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	MFC式 流量制御装置 10,200sccm	MFC本体、表示器、ス イッチ	1	807,975	807,975	2014/2/28	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC B13-102(200sccm), C41-113(10sccm)	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	マッフル炉-1	FP411	1	682,500	682,500	2014/3/5	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC 第4本棟 4105	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	マッフル炉-2	FP411	1	682,500	682,500	2014/3/5	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC 第4本棟 4105	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	大型マッフル炉	FUW252PA	1	658,350	658,350	2014/3/4	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC 第4本棟 4105	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	固定床流通反応器	設計温度400℃、設計 圧力6MPa、内径28mm	1	2,999,850	2,999,850	2014/3/6	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC C11-101	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	19管式ディストリビュータモ ジュールユニット	D304-023930-001 D304-023930-002	1	2,572,500	2,572,500	2014/3/7	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC 第4本棟 4205	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	光触媒パネル気液分離検討装 置 試作	気液分離膜評価用 SUS製	1	498,750	498,750	2014/3/7	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC C41-113	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	多孔質板光触媒パネルモデル 装置 試作	気泡流動観察用 多 孔質板、ガス及び水 導入管	1	837,900	837,900	2014/3/10	横浜市青葉区鴨志田町1000 三菱ケミカル(株) SIC B13-102	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	超音波ホモジナイザー	VCX-750	1	871,500	871,500	2013/12/5	愛知県名古屋市中熱田区六野2-4-1 JFCC研究棟R506	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	遊星型ボールミル	P-7	1	2,683,800	2,683,800	2013/12/11	愛知県名古屋市中熱田区六野2-4-1 JFCC研究棟R506	継続使用:可 傷:無 特記事項:無

区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	取得価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
(イ)	粒子径分布測定装置	NANO-flex	1	4,368,000	4,368,000	2013/12/16	愛知県名古屋市中熱田区六野2-4-1 JFCC研究棟R506	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	マイクロ波反応装置	μ -Reactor Ex	1	1,050,000	1,050,000	2014/1/16	愛知県名古屋市中熱田区六野2-4-1 JFCC研究棟R512	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	精密調湿発生器	me-40DP-H90-P-SUS	1	2,709,000	2,709,000	2014/2/21	愛知県名古屋市中熱田区六野2-4-1 JFCC研究棟R504	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	超高压バッチ試験機	Bridgman 高温高压電気炉	1	5,995,500	5,995,500	2013/3/15	神奈川県川崎市多摩区東三田1-1-1 明治大学生田キャンパス ハイテクイノベーションセンター H32号室	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	デル(株)製 ワークステーション (カスタマイズ)	Precision T760	1	1,303,374	1,303,374	2013/4/25	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部12号館 403	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	HP社製 ハイスペック・カスタム モデル「ワークステーション」	ENVY Phoenix h9-1490jp	1	449,778	449,778	2013/5/13	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部12号館 403	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	SONY社製ワークステーション	SVD1121AJ (112ASIN)	1	304,539	304,539	2013/5/22	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部12号館 403	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	米Apple社製 MacBookPro13イ ンチ Retinaディスプレイ	CTOZ	1	247,481	247,481	2013/6/28	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部12号館 401	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	(株)コンカレントシステムズ社製 ワークステーション	TS3D-E5(29)L-94a/DP/M2560	1	3,402,000	3,402,000	2013/7/31	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部12号館 403	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	ターボ分子ポンプ	TURBOVAC151	1	700,000	700,000	2014/3/25	東京都文京区弥生2-11-16 東京大学浅野キャンパス 工学部動力実験装置室 1F	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	高精度蒸気吸着量測定装置	BELSORP-aqua3-N	1	6,615,000	6,615,000	2013/1/25	名古屋市昭和区御器所町宇木市29番地 名古屋工業大学 2号館717A	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	小型窒素ガス発生装置	MODEL-02B	1	472,500	472,500	2013/3/7	名古屋市昭和区御器所町宇木市29番地 名古屋工業大学 2号館717A	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	高速昇温電気炉	S7-2035D	1	2,730,000	2,730,000	2013/3/7	名古屋市昭和区御器所町宇木市29番地 名古屋工業大学 2号館721A	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	ガス分離膜評価装置	ゼータ電位・粒径測定シ ステム ELSZ-10000ZS	1	8,400,000	8,400,000	2013/12/6	名古屋市昭和区御器所町宇木市29番地 名古屋工業大学 2号館717A	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	遠心分離機	HITACHI 本体CF15RN/ロー ターT15A36	1	976,500	976,500	2013/9/18	神奈川県川崎市多摩区東三田1-1-1 明治大学 生田キャンパス 第二校舎D館6 階 無機材料化学研究室(D617/618)	継続使用:可 傷:無 特記事項:無

区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	取得価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
(イ)	オンライン露点計	永野電機産業(株) ND-TA	1	386,400	386,400	2013/9/20	神奈川県川崎市多摩区東三田1-1-1 明治大学 生田キャンパス 第二校舎D館6階 無機材料化学研究室(D617/618)	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	ネットワークアナライザー	アシレント・テクノロジー(株) E5061B	1	2,901,675	2,901,675	2013/11/28	神奈川県川崎市多摩区東三田1-1-1 明治大学 生田キャンパス 第二校舎D館6階 無機材料化学研究室D618	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	精密電源装置(SMU)	アシレント・テクノロジー(株) B2902A	1	897,750	897,750	2014/2/13	神奈川県川崎市多摩区東三田1-1-1 明治大学 生田キャンパス 第二校舎D館6階 無機材料化学研究室D618	継続使用:可 傷:無 特記事項:無
(イ)	Precision T7600 Xeon プロセッ サー搭載モデル	Precision T7600 Xeon	1	664,650	664,650	2013/12/11	茨城県つくば市梅園1-1-1 産業技術総合研究所 つくば中央第5 5-2 0241号室	継続使用:可 傷:無 特記事項:無